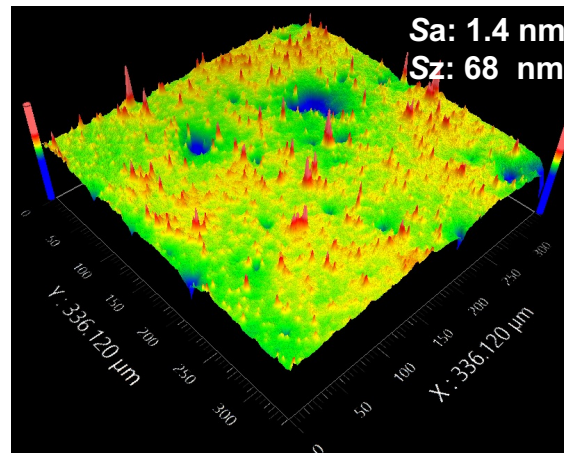
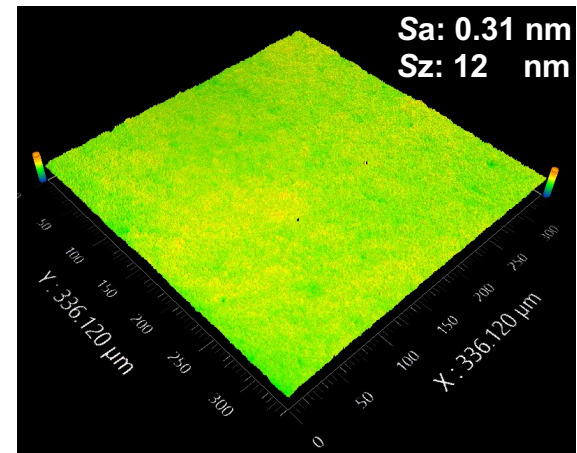


プラズマ援用研磨によるPCD基板の超平滑研磨



従来の化学機械研磨面



開発したプラズマ援用研磨面

2インチサイズPCDの研磨結果

プラズマ援用研磨 (PAP)により粒界段差が無く、常温接合が可能なSa 0.3 nmオーダの超平滑面を得ることに成功